

## 13 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

## Offenlegungsschrift ® DE 102 25 521 A 1

(f) Int. Cl.7: C 22 C 29/04



**DEUTSCHES** PATENT- UND MARKENAMT (21) Aktenzeichen:

102 25 521.0

(2) Anmeldetag:

10. 6.2002

(3) Offenlegungstag:

18, 12, 2003

(11) Anmelder: Widia GmbH, 45145 Essen, DE

(74) Vertreter:

Vomberg, F., Dipl.-Phys., Pat.-Anw., 42653 Solingen

② Erfinder:

Kassel, Dieter, Dipl.-Min., 58456 Witten, DE; Daub, Hans Werner, Dipl.-Ing., 51061 Köln, DE; Dreyer, Klaus, Dr. rer. nat., 45138 Essen, DE; Rödiger, Klaus, Dr. rer. nat., 44869 Bochum, DE; Lengauer, Walter, Prof. Dr.-Ing., Leobendorf, AT; Lovonyak, Mariann, Wien, AT; Ucakar, Vera, Wien, AT

(5) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

38 37 006 C3 199 22 057 A1 DE 198 48 376 A1 DE 197 09 980 A1 DE wo 02 27 054 A1

## Die folgenden Angeben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(S) Hartmetall-Substratkörper und Verfahren zu dessen Herstellung

Die Erfindung betrifft einen Hartmetall-Substratkörper, bestehend aus einer WC-Hartstoffphase und einer 3- bis 25 massen%igen Binderphase, die neben mindestens einem der Bindemetalle Fe, Co und/oder Ni noch bis zu 15 Massen% (bezogen auf die Binderphase) gelöste Dotierungsmittel enthält, die aus der Gruppe Al, Cr, Mo, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta stammen. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Hartmetall-Substratkörpers auf pulvermetallurgischem Weg mit abschließendem Sintern. Die Erfindung besteht darin, dass der prozentuale Anteil aller Dotierungsmittel im Hartmetall auf maximal 4 Massen% begrenzt ist, dass der Anteil einer kubischen Phase im Hartmetall kleiner als 4 Vol% ist und dass der Bindemetallgehalt in einer Hartmetall-Substratkörper-Randzone von bis zu 1 µm, vorzugsweise bis zu 0,5 µm, auf weniger als das 0,5fache des Bindergehaltes im Substratkörperinneren abfällt. Zur Herstellung wird in der Aufheizphase nach Erreichen des Eutektikums, aber spätestens nach Erreichen der Sintertemperatur, die Vakuum- oder Inertgasatmosphäre durch eine No-Atmosphäre ersetzt und zumindest bis zum Erreichen der Sintertemperatur aufrechterhalten.